

平成31年度 ナノテクキャリアアップアライアンス
京都大学 MEMS コース（前期 / 後期）

■目的：

マイクロスケールからナノスケールにおける微細加工技術（フォトリソグラフィ、成膜、エッチング、接合）は、ナノテクノロジーを駆使する MEMS/NEMS、電子デバイス、マイクロ流体デバイスの研究推進には必要不可欠です。

本コースでは、微細加工技術の初心者を対象に、微細加工技術の基本原理を学びつつ、京都大学ナノテクノロジーハブ拠点の微細加工装置を利用することで微細加工技術全体を総合的に理解し、簡単なデバイスを自分で設計、試作できる技術の習得を目指します。受講者は装置利用にあたって料金の補助を受けることができます。

■募集人数

前期・後期 各3名

■期間

前期：平成31年 4月1日（月）～ 平成31年9月30日（月）

後期：平成31年10月1日（火）～ 平成32年3月31日（火）

■実施場所

京都大学ナノテクノロジーハブ拠点

京都市左京区吉田本町 京都大学吉田キャンパス内 工学部物理系校舎3階327号

<http://www.nanoplat.cpier.kyoto-u.ac.jp/access/>

京都大学桂キャンパスCクラスター3棟

京都市西京区京都大学桂

<https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/access/katsura>（最寄バス停：桂御陵坂）

■内容：

受講者、本務の指導教員および技術支援担当者による打ち合わせを行い、受講者の専門やニーズに合わせて、個別に具体的な実施内容、実施形態を決定（オーダーメイドカリキュラム）します。オーダーメイドカリキュラムは、京都大学ナノテクノロジーハブ拠点での微細加工装置の操作実習や、デバイスの設計・試作実施といったメニューから、適宜組み合わせで作成します。実施形態は、定期的（毎週、2週間毎、毎月）、集中（1週間、2週間など）、定期と集中を組み合わせた実施など、多様な選択肢に対応します。

■受講料：

実費（ただし、装置利用料の累計20万円までは補助します）

■問合せ・申込先：

京都大学ナノ・マイクロシステム工学研究室内 CUPAL 事務局

（cupal@nms.me.kyoto-u.ac.jp、電話：075-383-3693）